DLCコーティングされたビーム エキサイターの開発

岡田雅之 外山毅 KEK J-PARC

本日の発表内容

- MRビームエキサイターについて
- ・マルチパクタリングとは
- ・コーティングの選定
- ・全DLCコートエキサイターの作成と導入
- ・運転後コーティング評価

ビームエキサイターについて



・ストリップライン型キッカー

ビームに同期させて、対向電極に逆位相の進行波を通 すことによりtransvers方向のキックを与える。

MR エキサイター



MR エキサイター



MR エキサイター





問題点: Tr RF Modeで運転する際、マルチパクタリングが発生して真空が 悪化しフルパワーでの運転が出来ない

マルチパクタリング

 平行電極の間にRF電場を印加した場合、電子が RFに同期して電極間を行き交う現象。



加速された電子が、電極表面に衝 突すると、そこから2次電子が発 生する。 衝突した電子(1次電子)の数より 2次電子の数が多い場合、電子数 は指数的に増大する。

→真空悪化、放電を引き起こす可能性がある。

マルチパクタリングの条件

平行平板電極に高周波電圧を印加した場合のマルチパクタリングの条件を考える。

電子の運動方程式



$$\frac{d^2x}{dt^2} = \frac{eV_0}{md}\sin(\omega t + \phi)$$

d: 電極間距離, e: 素電荷, m: 電子の質量

 $\dot{x}(0) = 0, x(0) = 0$ の条件でこの式を解くと、

$$x(t) = -\frac{eV_0}{\omega^2 m d} \left[\sin(\omega t + \phi) - \sin(\phi)\right] + \frac{eV_0 \cos(\phi)}{\omega m d} t$$

マルチパクタリングが起こる為には、 $t = (2n+1)\frac{\pi}{\omega}$ の時にx = dである必要があるので、

$$d = \frac{eV_0}{\omega^2 m d} [2\sin(\phi) + (2n+1)\pi\cos(\phi)]$$

n=0の場合、

$$0.267 \leq \frac{eV_0}{\omega^2 m d^2} \leq 0.5$$

マルチパクタリング対策

1. マルチパクタリングのRF条件 をずらす。

2. 発生する2次電子の数を減ら す。

対策1 コイルを巻く(従来)

• ビームと平行な磁場を発生させてマルチパクタリングの条件を変える。

$$\frac{d^{2}x}{dt^{2}} = \frac{eV_{0}}{md}\sin(\omega t + \phi) + \frac{e}{m}B_{Z}\frac{dy}{dt}$$
$$\frac{d^{2}y}{dt^{2}} = -\frac{e}{m}B_{Z}\frac{dx}{dt}$$

<エキサイター2の場合> 100ターン/セット × 6セット 電流 4A B_z = 約30G

運転中コイルの電源を維持しなくてはならないので、

対策2 二次電子放出を抑制

マルチパクタリングが発生しても、それが継続しないようにする。
電極を2次電子放出の少ない素材でコーティング。



ステンレスの素材に対して、3種類の処理をした電極を作成し、二次電子放出率とマルチパクタリングの様子を比較した。



・試料に電子が1つ衝突した時、いくつの電子が放出されるのかを表す割合。





試料に電子ビームを当てて、その 二次電子とコレクタ電流から求める。

SEYの測定は、久松さんの測定用 ベンチをお借りして行いました。 ありがとうございました。

マルチパクタリングが持続しない為にはSEY<1が一つの目安

SEYの 測定



各試料に対して、取付直後と、 150 24時間のベーキング後に SEYの測定を行った。

いずれの試料も300eV付近に ピークがあり、ベーキングによ りSEYが減少する事が分かる。 また、DLCが一番良好であっ た。

電子ビームによるエージングを する事でSEYをさらに減少させ ることが出来たが、全域で1を 割るまでには至らなかった。



実機を用いてRFの周波数・電圧を変えながら、マルチパクタリングによる真空の変化を測定した。



電極間、電極-チェンバー間でマルチパクタリングによる真空の悪化が確認される。





TiN

SUS



DLC

・DLCが一番よかったが、 それでも電極-チェンバー (SUS)間が残ってる。

チェンバー内壁もコー ティングする事にした。



真空の悪化はほとんどない。

様に見えるが拡大するとマルチパクタリングによる構造が 残っているのが分かる。 とは言え、1*10⁻⁵ Pa以下でありリングに設置する事にした。

加速器運転中の真空



加速器の運転中、エキサイターはフィードバックシステム の一部として運用。直近のイオンゲージで監視した 真空は常用に問題の無いレベルだった。

コーティングに対するビームの影響



Frequency (MHz)

VAC (Pa)

4.500e-5

4.276e-5 4.053e-5 3.829e-5

3.605e-5 3.382e-5

3.158e-5 2.934e-5

2.711e-5

2.487e-5 2.263e-5 2.040e-5 1.816e-5

1.593e-5 1.369e-5

1.145e-5

9.216e-6 6.979e-6

4.743e-6 2.507e-6 2.700e-7 運転終了後、コーティングに対 するビームの影響を調べる 為、マルチパクタリングテスト を行った。

但し、ゲージやポンプの位置 がテストベンチと異なる為、単 純には比較できない。

傾向としては同じであり、特に問題は生じてないと考えている。

電極のRF透過率





運転の前後で違いはほとんどなかった。

まとめ

- MRエキサイターでは増設にあたり、電極をDLC コーティングする事でマルチパクタリングを抑制 する事にした。しかし、電極だけでは不十分で あったので電極及びチェンバーの内壁もDLCで コーティングした物を作成した。
- テストベンチでの測定ではマルチパクタリングが 発生しても真空は1*10⁻⁵Pa以下であり、実用上問 題の無いと判断。実際にリングに設置しフィード バックシステムの一部として運用している。
- 運転終了後、ビームに晒された影響を調べるためマルチパクタリングテスト等をしたが問題は無いようだった。この測定は今後も続ける予定。